

Dry Polishing Wheels



DP08SERIES

不使用化学药品亦可去除残余应力的干式抛光轮

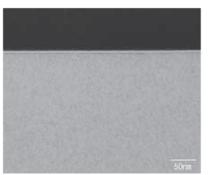
该产品不仅适用于一般的晶圆研磨,亦适用于**DBG** 技术,不使用化学药品也可去除残余应力

DP08系列利用迪思科公司独立开发的干式抛光技术,可以对超薄晶圆进行研磨。无需使用化学药品,因此对环境负荷小,而且与使用研磨液(膏)相比,操作更容易,实现了高抗折强度的芯片。



研磨损伤比较(TEM观察)

经过干式抛光加工后,可除去晶圆中的研磨损伤。





DP08抛光后

加工对象

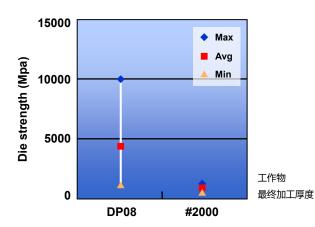
矽晶圆、其他材料

技术规格



实验结果

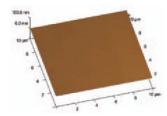
抗折强度(球压式抗折强度测量法)

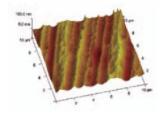


: Φ8 " 矽晶圆 工作物

: 200 µm

表面粗糙度





Ra (µm)	0.0003	0.0150
Ry (µm)	0.0017	0.0800

本公司的所有产品都已加入产品赔偿责任保险。

下订单时

在下订单时,请用户将产品的类型名称、外径、研削磨轮直径及数量通知本公司,另外在初次订购时,本公司销售窗口会根据不同加工要求,协助用户选择适合的产品。用时请一并提供研削材料、尺寸、形状、所用设备(装置)及其它相关加工条件等数据。

为了改进产品,本公司可能在未通知用户的情况下,就对产品规格进行变更,因此请仔细核对规格后再下订单。

为了安全使用本公司的各种产品

- 请使用安全挡板(包括喷嘴外壳或外盖)。
 在使用注有限制旋转数的精密加工冶具时,请不要超出其规定的旋转数范围。
 在安装精密加工冶具时,请遵照设备(装置)使用说明书的规定,正确地进行安装。请不要使精密加工冶具时落在地上,或发生磁增。
 在每次使用精密加工冶具前必须先进行检查,如果有缺口或其它破损,请停止使用。
- 在开始使用前,请先仔细阅读相关设备(装置)的使用说明书。
 请不要使用经过改装的设备(装置)。
 请不要使用不符合设备(装置)指定尺寸的精密加工冶具。
 除了研制、切割权别悄下业以外、请不要使用在其它用途。
 在使用湿式研削、切割用精密加工冶具时,请使用冷却液。



DISCO CORPORATION

www.disco.co.jp